

## 産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2013年 11月公開分(37件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2013-226082	カプトエビの卵の孵化率向上方法	奥洲物産運輸株式会社 株式会社REO研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2013-226387	パーソナルビークル制御装置	アイシン精機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2013-229257	硫黄系正極材料を用いた全固体リチウム二次電池	独立行政法人産業技術総合研究所 出光興産株式会社 株式会社豊田自動織機
4	特開2013-229283	酸化物透明導電膜、およびそれを用いた光電変換素子、光検出素子	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2013-229388	多積層量子ドット構造体およびその製造方法、並びにそれを用いた太陽電池素子	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2013-230689	メンバーズカードの形成方法及び発行されたメンバーズカードの識別ステッカー	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社バスター
7	特開2013-231245	表面処理された炭素繊維および炭素繊維-樹脂複合材料	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人東京工業大学 国立大学法人長岡技術科学大学 独立行政法人国立高等専門学校機構
8	特開2013-231640	加速器によるパルスビーム陽電子寿命計測方法および装置	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2013-231919	インク材料の改質方法及びインク材料の改質装置	東京エレクトロン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 DIC株式会社
10	特開2013-232471	相補型半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2013-232553	炭化珪素半導体素子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社 株式会社アルバック
12	特開2013-232554	炭化珪素半導体装置の製造方法および炭化珪素半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
13	特開2013-232556	炭化珪素半導体素子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
14	特開2013-232557	炭化珪素半導体素子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
15	特開2013-232558	炭化珪素半導体装置の製造方法および炭化珪素半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
16	特開2013-232559	炭化珪素半導体装置の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
17	特開2013-232560	炭化珪素半導体装置の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
18	特開2013-232561	半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
19	特開2013-232562	半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
20	特開2013-232563	炭化珪素半導体装置の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
21	特開2013-232564	半導体装置および半導体装置の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
22	特開2013-232565	炭化珪素半導体素子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
23	特開2013-233096	遺伝子連結法およびそれを用いた単鎖抗体作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2013-233511	塗膜材塗布装置、長尺部材への塗膜材の塗布方法	古河電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
25	特開2013-233584	鋳型及び鋳型の製造方法	富士化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2013-233761	転写装置および転写方法	東芝機械株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2013-234077	水素製造装置、及びそれを用いた水素製造方法	株式会社豊田自動織機 独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社光触媒研究所
28	特開2013-235122	微小物の3次元操作装置	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2013-235666	電池用正極活物質およびその製造方法	本田技研工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2013-235801	電子顕微鏡用試料、電子顕微鏡画像形成方法及び電子顕微鏡装置	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2013-236017	電子装置、積層構造体及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2013-236984	液体の気化装置および液体の気化方法	独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2013-237060	レーザー誘起背面式の透明基板微細加工を行う加工装置	独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2013-238021	地質・地層変化検知装置及び検知方法	独立行政法人産業技術総合研究所 古河機械金属株式会社
35	特開2013-238241	ディーゼルエンジンのフィルタ再生方法	独立行政法人産業技術総合研究所 植杉 直幹
36	特開2013-238426	水質分析装置及び水質分析方法	独立行政法人産業技術総合研究所 テクノ・モリオカ株式会社
37	特開2013-238455	レーザーアブレーションを用いた定量分析用の粉末試料ディスク及びその製造方法並びにそのための装置	独立行政法人産業技術総合研究所